

研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム

産学共同(育成型) 事後評価結果

体系的課題番号	: JPMJTR20RT
採 択 年 度	: 2020 年度
分 野	: ICT・電子デバイス、ものづくり分野
研究開発課題名	: 能動制御型超音波援用スラリーレス電気化学機械研磨法の開発
プロジェクトリーダー 研究責任者	: 山村 和也(大阪大学)

評価結果の総合所見

本課題は、革新的なパワー半導体ウエハ研磨技術の実現に向け、超音波援用電気化学機械研磨プロセスの開発を目指すものである。

目標の一部が達成できなかったものの、具体的な企業との連携を進めており、今後の取り組み次第では次の研究開発フェーズに進める可能性がある。

抽出された提案技術の効果と課題に基づき、各種研磨技術との組合せも含め、企業のニーズに適した実用化に向けて検討を進めてほしい。

以上